

Результирующие значения эквивалентной шуму разности температур, полученных после реализации процедуры выравнивания, для трех рассматриваемых приемников представлены ниже:

Номер образца	Эквивалентная шуму разность температур, %
1.....	100
2.....	93
3.....	69

Из приведенных результатов следует, что вне зависимости от метода выравнивания значительный исходный разброс чувствительности в матрице имеет существенное значение для формирования характеристик тепловизионного прибора. Значительный разброс в каналах матрицы приводит к снижению характеристики прибора. При этом надо заметить, что даже при относительно небольшом общем разбросе чувствительности элементов в матрице наличие отдельных единичных каналов, имеющих значение чувствительности заметно ниже среднего на фоне остальных элементов с чувствительностью, близкой к среднему значению, приводит к заметному снижению характеристик системы, что связано с ошибками вычисления коэффициентов коррекции, вызванных наличием этих каналов. Понятно, что

наибольший вклад в ухудшение характеристик вносят каналы, имеющие уровень чувствительности, лишь ненамного превышающий "дефектный" уровень, поскольку такие каналы пропускаются при реализации процедуры замены сигналов в "дефектных" каналах и вносят отрицательный вклад в качество выравнивания геометрического шума в тепловизионной системе.

#### Л и т е р а т у р а

1. Овсяк В. Н., Курьшев Г. Л., Сидоров Ю. Г. и др. Матричные фотоприемные устройства ИК-диапазона. — Новосибирск: Наука, 2001.
2. Алеев Р. М., Иванов В. П., Овсянников В. А. Основы теории анализа и синтеза воздушной тепловизионной аппаратуры. — Казань: Изд-во Казанск. ун-та.
3. Вафиади А. В., Нацхи В. А., Шабашев О. К. Экспериментальное исследование влияния геометрического шума на основные характеристики тепловизионного прибора// Оптический журнал. 1997. Т. 64. № 2. С. 17.
4. Макаров А. С., Омелаев А. И., Филиппов В. Л. Введение в технику разработки и оценки сканирующих тепловизионных систем. — Казань: Унипресс, 1998.
5. Ллойд Дж. Системы тепловидения/ Пер. с англ. — М.: Мир, 1978.

Статья поступила в редакцию 23 ноября 2004 г.

## Modeling of characteristics of array photodetecting device in composition with the thermal imaging system

V.A. Baloev, V.P. Ivanov, Y.M. Latypov  
State Institute of Applied Optics, Kazan, Russia

*Multielement photodetectors have a considerable spread of sensitivity between the elements, and that leads to the noise appearance on the output image due to the difference of output elements voltage at similar parameters of irradiated signal. In order to exclude the pointed image defects they used different methods of channel sensitivity equalization. At that we should notice that the efficiency of such equalization depends in many respects on the parent voltage sensitivity range of multielement photodetector.*

УДК 621.315.592

## Фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов $n$ - $\text{InSe}\langle\text{PЗЭ}\rangle/n\text{-CuInSe}_2$ в видимой и ближней ИК-областях

А. Ш. Абдинов, Р. Ф. Бабаева, Р. М. Исмаилов, Г. Х. Эйвазова  
Бакинский государственный университет, г. Баку, Республика Азербайджан

*Методом посадки на оптический контакт созданы изотипные гетеропереходы  $n$ - $\text{InSe}\langle\text{PЗЭ}\rangle/n\text{-CuInSe}_2$  с процентным содержанием введенной примеси  $N_{\text{REE}} = 0; 10^{-5}; 10^{-4}; 10^{-3}; 10^{-2}$  и  $10^{-1}$  ат. % редкоземельных элементов (PЗЭ) типа гадолиния, гольмия и диспрозия. Исследованы их фотоэлектрические свойства в режимах фотопроводимости, фотоЭДС и фотодиода при различных ориентациях падающего света относительно контактирующих*

**компонентов и температурах (77 и 300 К). Обнаружены заметные зависимости основных фотоэлектрических характеристик изучаемых структур от  $N_{REE}$  и предложены механизмы для их объяснений.**

Значительная фоточувствительность при температурах вплоть до 350 К в широком диапазоне длин волн света ( $0,35 \leq \lambda \leq 1,20$  мкм) и слоистость структуры делают монокристаллы  $n$ -InSe перспективным и интересным материалом не только с научной, но и с практической точки зрения. Этот полупроводник может быть пригодным для создания и изучения неохлаждаемых фотоприемников, работающих в видимой и ближней ИК-областях спектра. К настоящему времени немало работ посвящено изучению фотоэлектрических свойств специально нелегированных кристаллов  $n$ -InSe и некоторых электрических структур на их основе. В данной работе исследованы фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов  $n$ -InSe<PЗЭ>/ $n$ -CuInSe<sub>2</sub> в видимой и ближней ИК-областях спектра ( $0,30 \leq \lambda \leq 2,00$  мкм), созданных методом посадки на оптический контакт\*.

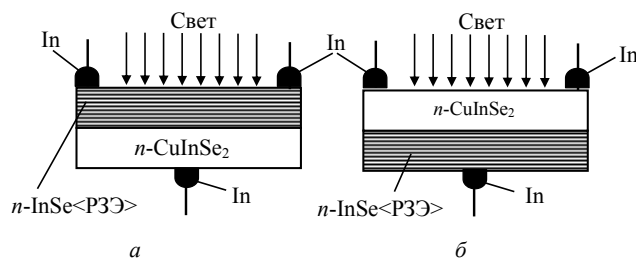
### Эксперимент

Использованные монокристаллы  $n$ -InSe<PЗЭ> с примесями редкоземельных элементов (PЗЭ) типа гадолиния (Gd), гольмия (Ho) и диспрозия (Dy) при различных уровнях легирования ( $N_{REE} = 0; 10^{-5}; 10^{-4}; 10^{-3}; 10^{-2}$  и  $10^{-1}$  ат. %) и  $n$ -CuInSe<sub>2</sub> получены методами Бриджмена и медленного охлаждения при постоянном градиенте температуры вдоль слитка. Концентрация свободных электронов в них при 300 К составляла  $10^{14}$ — $10^{15}$  см<sup>-3</sup> и  $\sim 10^{16}$  см<sup>-3</sup>, соответственно. Для различных образцов толщина  $n$ -InSe<PЗЭ> и  $n$ -CuInSe<sub>2</sub>-компонентов варьировалась в пределах  $\sim 10$ —100 мкм и  $\sim 0,5$ —1,0 мм, соответственно, а поперечные размеры их составляли  $\sim (2 \times 3)$  мм.

Выбранные размеры контактирующих слоев, а также относительная мягкость (пластичность) кристаллов  $n$ -InSe<PЗЭ> позволяли обеспечить удовлетворительное качество прямого оптического контакта между компонентами изучаемых структур.

Токовые контакты получали путем припаивания металлического индия или серебряной пасты на свободные поверхности контактирующих компонентов, и они являлись омическими при рассмотренных нами условиях.

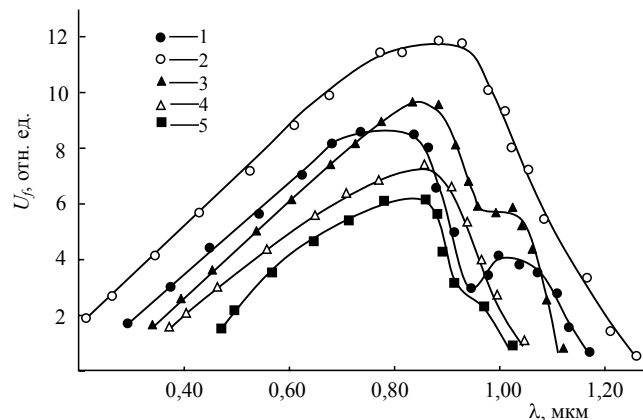
Схематическое изображение исследуемых структур приведено на рис. 1.



**Рис. 1. Схематическое изображение изучаемых структур  $n$ -InSe<PЗЭ>/ $n$ -CuInSe<sub>2</sub> при освещении:**  
а — со стороны  $n$ -InSe<PЗЭ>-компоненты; б — со стороны  $n$ -CuInSe<sub>2</sub>-компоненты

Измерения проводили в интервале  $77 \leq T \leq 450$  К как в фотовольтаическом режиме, так и в режиме фотопроводимости. При измерениях свет падал в направлении, перпендикулярном плоскости перехода и естественным слоям  $n$ -InSe<PЗЭ>-компоненты.

Снимались спектральное распределение (рис. 2) и световая зависимость (рис. 3) фоточувствительности для структур с различным значением  $N_{REE}$ , а также при различных ориентациях освещения относительно контактирующих компонентов.



**Рис. 2. Спектральное распределение фоточувствительности структур  $n$ -InSe<PЗЭ>/ $n$ -CuInSe<sub>2</sub> с различной  $N_{REE}$  при освещении со стороны  $n$ -InSe<PЗЭ>-компоненты;**  
 $N_{REE}$ , ат. %: 1, 4 — 0; 2 —  $10^{-5}$ ; 3 —  $10^{-1}$ ;  
Т, К: 1, 2, 3 — 77; 4, 5 — 300

Оказалось, что при освещении изучаемых структур  $n$ -InSe<PЗЭ>/ $n$ -CuInSe<sub>2</sub> со стороны  $n$ -InSe<PЗЭ>-компоненты в фотовольтаическом режиме спектральное распределение ее фоточувствительности при  $N_{REE} = 0$  охватывает диапазон длин волн  $0,35 \leq \lambda \leq 1,25$  мкм и  $0,40 \leq \lambda \leq 1,10$  мкм при 77 и 300 К, соответственно. При 77 К на кривых спектрального распределения фоточувствительности изучаемых структур, помимо основного ярковыраженного максимума ( $\lambda \approx 0,90$  мкм), в некоторых случаях наблюдается и слабый второй макси-

\* Бакуменко В. Л., Чижко В. Ф. Электрические свойства оптических контактов слоистых полупроводников// ФТП. 1977. Т. 11. В. 11. С. 2000—2002.

мум в районе  $\lambda \approx 1,02$  мкм. С ростом процентного содержания введенной примеси до  $10^{-4}$  ат.% спектральное распределение fotocувствительности изучаемых структур расширяется с обеих сторон относительно исходного ( $N_{\text{REE}} = 0$ ).

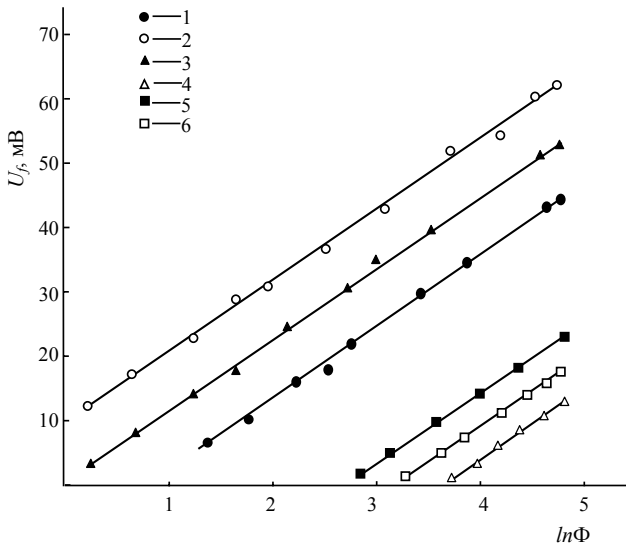


Рис. 3. Световая зависимость фотонапряжения в структуре  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle/n\text{-CuInSe}_2$  при различных уровнях легирования P3Э;  $N_{\text{REE}}$ , ат. %: 1, 4 — 0; 2 —  $10^{-5}$ ; 3, 6 —  $10^{-1}$ ; T, K: 1, 2, 3 — 77; 4, 5, 6 — 300

При 77 К спектральное распределение fotocувствительности структур, освещенных со стороны  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle$ -компоненты с  $N_{\text{REE}} = 10^{-5}$  ат.% охватывает диапазон длин волн  $0,30 \leq \lambda \leq 1,34$  мкм с основным максимумом при  $\lambda \approx 1,00$  мкм, а второй — относительно слабый максимум при этом исчезает. С дальнейшим ростом  $N_{\text{REE}}$  спектральное распределение fotocувствительности структур  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle/n\text{-CuInSe}_2$  заметно сужается, и при  $N_{\text{REE}} \approx 10^{-1}$  ат. % оно охватывает диапазон длин волн  $0,40 \leq \lambda \leq 1,10$  мкм с максимумами при  $\lambda \approx 0,90$  мкм (основной) и  $\lambda \approx 1,00$  мкм (дополнительный). При рассмотренных условиях в основном наблюдается зависимость спектрального распределения fotocувствительности изучаемых структур от количества, а не от введенного материала P3Э-примеси.

Установлено, что в структурах как  $n\text{-InSe}/n\text{-CuInSe}_2$ , так и  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle/n\text{-CuInSe}_2$  при освещении монохроматическим светом с энергией  $\epsilon_{g2} \leq hv < \epsilon_{g1}$ , где  $\epsilon_{g1}$  и  $\epsilon_{g2}$  — значения ширины запрещенной зоны широкозонного  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle$ - и узкозонного  $n\text{-CuInSe}_2$ -компонент, соответственно, в рассмотренных нами условиях fotocувствительность почти не наблюдается, а при  $hv > \epsilon_{g1}$  спектральное распределение fotocувствительности изучаемых структур и фоторезисторов, изготовленных на основе  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle$ , совпадает. Однако при этом в коротковолновой части спектра fotocувствительность резко уменьшается. При освещении изучаемых структур со стороны слоя  $n\text{-CuInSe}_2$  как в фотовольтаическом режиме, так и в ре-

жиме fotocувствительность при 77 К сильно уменьшается относительно имеющей место при освещении со стороны  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle$ -компоненты, а при 300 К — совсем исчезает.

Изучены также фотоэлектрические свойства структур  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle/n\text{-CuInSe}_2$  при освещении кратковременными световыми импульсами с большой мощностью ( $\sim 5 \cdot 10^2$  лк). Измерения проводились как в вентильном, так и фотодиодном режиме. Снималась зависимость фотоЭДС от интенсивности падающего на структуру света (см. рис. 3), и установлено, что она хорошо подчиняется существующим в научной литературе представлениям о формировании фотоЭДС в диодных структурах. Уместно отметить, что этот результат в свою очередь является еще одним достоверным подтверждением создания при посадке на прямой оптический контакт кристаллов  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle$  и  $n\text{-CuInSe}_2$  диодной структуры.

### Обсуждение

Полученные результаты могут быть объяснены наличием энергетического барьера в валентной зоне, которая препятствует пространственному разделению неосновных носителей заряда при освещении изучаемых структур со стороны узкозонной  $n\text{-CuInSe}_2$ -компоненты и уменьшению глубины проникновения падающего на структуру света в  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle$  при больших энергиях фотонов вследствие возникновения прямого перехода в более высокую зону проводимости, а также зависимости степени пространственного упорядочения используемых кристаллов  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle$  от  $N_{\text{REE}}$ .

Полученные результаты также свидетельствуют о возможности управления параметрами и характеристиками изучаемых гетероструктур и фотоприемников на их основе путем варьирования содержания введенной примеси P3Э типа Gd, Ho и Dy. При этом, выбирая оптимальное значение  $N_{\text{REE}}$ , можно создавать на основе гетероструктур  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle/n\text{-CuInSe}_2$  фотоприемники для широкого (видимого и ближнего ИК) диапазона спектра с более стабильными характеристиками и параметрами.

Зависимость свойств и параметров гетероструктур  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle/n\text{-CuInSe}_2$  в основном от  $N_{\text{REE}}$ , а не от материала введенной примеси, говорит о том, что влияние легирования на свойства изучаемых образцов в рассмотренном случае не связано с электронной структурой введенных примесей, а определяется особенностями самого полупроводника  $n\text{-InSe}$ . Появление второго (слабого) максимума на спектральном распределении fotocувствительности при освещении изучаемых структур со стороны широкозонного компонента, скорее всего, обусловлено "эффектом окна", при этом фотоны с  $hv > \epsilon_{g1}$ , не поглощаясь в  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle$ , падают на  $n\text{-CuInSe}_2$  и в этом слое создают fotocувствительность.

Отсутствие fotocувствительности при освещении изучаемых структур со стороны  $n\text{-InSe}\langle\text{P3Э}\rangle$  светом с  $\epsilon_{g2} \leq hv < \epsilon_{g1}$  объясняется тем, что такой свет поглощается в

$n$ -CuInSe<sub>2</sub>-слое, а из-за наличия потенциального барьера в валентной зоне структуры созданные при этом дырки не переходят из  $n$ -CuInSe<sub>2</sub> в  $n$ -InSe<PЗЭ>. С этой позиции объясняется также незначительность фоточувствительности изучаемых структур при освещении со стороны  $n$ -CuInSe<sub>2</sub>.

Отличие коротковолновой части спектра фоточувствительности изучаемых структур при освещении со стороны  $n$ -InSe<PЗЭ> светом с  $h\nu > \epsilon_{g1}$  от спектрального распределения фотопроводимости фоторезистора на основе  $n$ -InSe<PЗЭ> связано с уменьшением глубины поглощения коротковолновых фотонов. В результате этого

неравновесные носители заряда генерируются на участке слоя, находящимся далеко от перехода. Поэтому пространственного разделения этих электрон-дырочных пар барьером гетеропереходов не происходит.

В заключение можно отметить, что путем легирования PЗЭ типа Gd, Ho и Dy можно управлять фотоэлектрическими параметрами и характеристиками созданных методом посадки на прямой оптический контакт изотипных гетеропереходов  $n$ -InSe<PЗЭ>/ $n$ -CuInSe<sub>2</sub> в видимой и ближней ИК-областях спектра, а также создавать структуры с более стабильными свойствами.

Обнаруженное влияние легирования PЗЭ на свойства этих гетеропереходов определяется в основном процентным содержанием, а не материалом введенной примеси. Это обусловлено тем, что при легировании кристаллов  $n$ -InSe<PЗЭ> меняется их степень пространственной неоднородности.

Статья поступила в редакцию 23 ноября 2004 г.

## Photoelectric properties of isotype heterojunctions $n$ -InSe<REE>/ $n$ -CuInSe<sub>2</sub> in visible and near IR-region

A. Sh. Abdinov, R. F. Babayeva, R. M. Ismayilov, G. H. Eyvazova  
Baku State University, Baku, Azerbaijan

*By the method of landing to optical contact isotype  $n$ -InSe<REE>/ $n$ -CuInSe<sub>2</sub> heterojunctions with percentage of introduced impurity  $N_{REE} = 0; 10^{-5}; 10^{-4}; 10^{-3}; 10^{-2}$  and  $10^{-1}$  at. % rare-earth elements (REE) of gadolinium, holmium and dysprosium have been created. Their photoelectric properties in photoconductivity, photoEMF and photovoltaic modes have been investigated at different orientations of incident light relative to contacting components and temperatures (77 and 300 K). Appreciable dependence of the basic photo-electric characteristics of investigated structures on  $N_{REE}$  have been found out and mechanisms for their explanations have been offered.*

УДК 621.382.002

## Разработка InGaP-фотокатода для электронно-оптических преобразователей

Н. И. Беспалко, В. И. Сахно, А. В. Долгих  
ОАО "Катод", г. Новосибирск, Россия

А. А. Мармалюк  
ФГУП «НИИ "Полус" им. М. Ф. Стельмаха», Москва, Россия

*Представлена разработка InGaP-фотокатода для электронно-оптических преобразователей (ЭОП), работающих в видимом диапазоне спектра. Оптимизированы технологические и конструктивные параметры InGaP-фотокатода. С помощью метода дифракции быстрых электронов оценено качество подготовки поверхности фотокатода перед активировкой. Герметизированные в ЭОП образцы фотокатодов имели интегральную чувствительность  $S = 300$  мкА/лм и квантовую эффективность на длине волны 560 нм –  $QE = 30$ %. Намечены пути дальнейшего усовершенствования InGaP-фотокатода.*

© Беспалко Н. И., Сахно В. И., Долгих А. В., Мармалюк А. А., 2007

Широкие области применения ЭОП и постоянное повышение требований к параметрам этих приборов неуклонно ведут к совершенствованию технологии их производства и поиску новых материалов для фотокатодов.

Основным узлом ЭОП является фотокатод. В настоящее время в качестве фотокатодных узлов используются многощелочные фотокатоды и фотокатоды с отрицательным электронным сродством (ОЭС) на соединениях A<sup>III</sup>B<sup>V</sup> (в основном GaAs). Перспективны-